Матрицу T(ω) можно рассматривать как матрицу преобразования сигналов. Новые сигналы имсют вид

$$\vec{S}_{x}'(\omega) = T(\omega)\vec{S}_{x}(\omega), \ \vec{S}'(\omega) = T(\omega)\vec{S}_{y}(\omega).$$
 (6)

На основе (5)и (6) получим

$$S'_{v}(\omega) = D(\omega)S'_{x}(\omega).$$
 (7)

rge $D(\omega) = diag\{d_1(\omega), d_2(\omega), \dots, d_m(\omega)\}$.

Уравнение (7) устанавливает связь между входными и выходными спектральными плотностями "развязанной" системы, которая эквивалентив исходной многосвязной системе.

Используя уравнение (1) и определяя $D(\omega)$, получим асимптотики для матрицы преобразования $T(\omega)$ и для преобразованных сигналов

$$\hat{S}'_{x}(\omega) = \hat{T}(\omega)\hat{S}_{x}(\omega), \quad \hat{S}'_{y}(\omega) = \hat{T}(\omega)\hat{S}_{y}(\omega). \tag{8}$$

которые действуют в "развязанной" асимптотически эквивалентной системе. Полученные асимптотически эквивалентные матрицы рекомендуются для их использования при анализе многосвязных систем.

ЛИТЕРАТУРА

I. Арешян Г.Л. Энергетические матрицы многосвязных систем // Изв. НАН РА пГИУА. Сер. ТН. - 1996. - Т. 49, № 1 - С. 32-36.

2. Восводин В.В., Кузнецов Ю.А. Магрицы и вычисления. - М.: Наука, 1984. - 318 с

ГИУА 10.11.1996

Изв. НАН в ГИУ Армении (сер. ТН), т. L. № 2, 1997, с. 114 - 119.

УДК 628.314

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

В.М. МОВСЕСЯН, Г.В.БАРЕГАМЯН, Н.Н. ПЕТРОСЯН, А.Ш. АРУТЮНЯН

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ В ИСТОЧНИКАХ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

՝ Հետագոտվում են միջանկյալ բարձր հաձախականային կերպափոխիչով երկրորդային սնման աղբյուրներում մազնիսական տարրերի (տրանսֆորմատորներ, դրոսելներ). Էլեկտրամագնիսական ձառագայթումները։ Նկարագրված են Էլեկտրամագնիսական նանգագրվան են Էլեկտրամագնիսական նանգարումները և միջոցները։ ՝ Տետագոտված էլեկտրամագնիսական ձառագայթումների ձնչման նպատակով տարբեր նյութերին պատուսական էկրանային ծածկույթների օգտագործման արդյունավետությունը։ Բերվում են երկրորդային էլեկտրամուցման աղբյուրներում Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության ապահովման գործնական առաջարկություններ։

Исследуются электромагнитные излучения от магнитных компонентов (транеформаторы, дроссели) источников вторичного электропитания с промежуточным высокочастотным преобразователем. Описаны средства и методика проведения измерсний электромагнитных помех. Исследована эффективность

применения экранных покрытий из магнитных и немагнитных материалов для подавления электромагнитного излучения. Приводятся практические рекомендации для обеспечения электромагнитной совместимости компонентов источников иторичного электропитания.

Ил. 4. Библиогр.: 3 назв

Electromagnetic interferences caused by magnetic components (such as transformers, chokes) of secondary power supplies with an intermediate high frequency converter are explored. The means and methods of electromagnetic interference measurements are described Efficiency of screen coating application involving magnetic and nonmagnetic materials for suppressing electromagnetic irradiations is investigated. Suggestions for providing electromagnetic compatibility with secondary power supply components are given

1// 4 Rot 3.

Одним из актуальных направлении современной силовой электроники является создание эффективных и экономичных источников вторичного электропитация (ИВЭП), предназначенных для питация средств вычислительной техники и радиоэлектронных систем. В теории и проектировании ИВЭП вопросы исследования электромагинтной совместимости (ЭМС) отдельных его компонентов изучены недостаточно полно.

В данной работе ставится задача исследования ЭМС ИВЭП с целью выработки средств и методов эффективного снижения уровня влектромагнитного излучения отдельных компонентов ИВЭП Это дает возможность повысить надежность самих ИВЭП и улучшить

электромагнитную обстановку окружающей среды.

Коммутационные процессы в узлах ИВЭП, наличие магнитных элементов в высокочастотных цепях вызывают в окружлющей среде вестационарные и/или периодические импульсные электромагнитные поля помех, которые индуцируют импульсные токи и напряжения в слабосигнальных ценях управления и могут являться причиной сбоев в работе ИВЭП. Для локализации действия электромагнитного поля. создаваемого источником поля, и защиты узлов ИВЭП от их влияния, применяются экраны. По принципу лействия различают электростатическое, магнитостатическое и электромагнитное вкранирование [1-3]. Первые два, действующие по принципу замыкания соответствующих полей, вследствие повышенной электро- и магнитопроводимости материалов экранов эффективны лишь в области низких частот. Деиствие электромагнятных экранов может быть представлено как многократное отражение электромагнитных воли от воверхности экрана и затухание энергия в толще металлического экрана. которое обусловлено тепловыми потерями на вихревые токи в металяе.

Импульсные электромагнитные помехи оцениваются амплитудами нипряженности электрического и магнитного полей, длительностью импульсов и их фронтов, вольт-секундной плошавью и частотными мектрами. Для количественной оценки эффективности экранирования

вепользуется ряд параметров [3], основные из которых:

-коэффициент экранирования С. равный отношению амилитуды выпряженности электрического поля Е, (или магнитного Н) в какой-либо точке пространства (вблизи экрана) к амплитуде напряженности Е (или П) поля в этой же точке в случае, если бы экран отсутствовал, т.е.

$$C_{e} = E_{e} / E_{e} = H_{e} / H_{e}$$
 (1)

— экранное затухание, которое определяется как величина, обратная коэффициенту экранирования. В логарифмическом масштабе оно определяется следующим образом:

$$S = 20 \lg (1/C)$$
. (2)

Следует отметить, что электромагнитное поле воздействует на окружающую среду не само по себе, а в результате наведенных в цепях аппаратуры импульеных напряжений помех. Поэтому достаточно измерять напряжения, наведенные в искоторых регламентированных видах антенн.

Общая структурная схема измерителя электромагнитных помех в ИВЭП представлена на рис. 1. Основными элементами измерителя являются рамочная антенна А и регистрирующее устройство (осциллограф Осц или пифровое регистрирующее устройство ЦРУ с преобразователем). ЭДС, наведенная электромагнитным полем в витках антенны, определяется следующим образом:

$$e = n\mu\mu_0 QdH/dt, \qquad (3)$$

где n-количество витков: Q-площадь витка; $\mu-$ магнитная проницаемость сердечника; μ_0- магнитная постоянная.

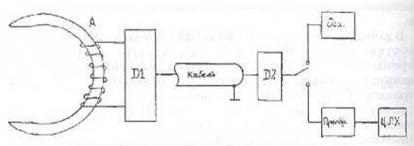


Рис. 1. Структурная схема измерительной цепи

Если индуктивное сопротивление антенны намного больше сопротивления нагрузки, то форма изменения во времени тока в витках антенны, а следовательно, и форма напряжения на нагрузке сравнима с формой приложенного импульсного магнитного поля H(t):

$$i(t) = n\mu\mu_0 QH(t)/L_a, \tag{4}$$

где L - индуктивность антенны.

Делители Д1 и Д2 (рис. 1) служат для согласования выхода антенны с кабелем и кабеля со входом измерительного прибора. Достоверность результатов экспериментального измерения электромагнитных помех в ИВЭП в значительной степени зависит от стойкости измерительной аппаратуры к воздействиям электромагнитных полей. Для этого измерительная аппаратура размещается в экранированной камере или на некотором расстоянии от ИВЭП.

Экспериментальные исследования проводились на макете ИВЭП с высокочастотным резонансным инвертором, упрощенная схема которого представлена на рис. 2. В основном были исследованы электромагнитные излучения в выходных трансформаторах драиверов (TU1, TU2), сигналы которых имеют крутые фронты, являющиеся причиной высокочастотных составляющих в спектре электромагнитного излучения; дросселе L3, сигнал которого имеет форму кратковременных пиков с большой амплитудой;

драсселях L1, L2 и выходном силовом трансформаторе, сигналы которых вмеют форму, близкую к синусондальной. Измерения электромагнитных помех проводились с помощью датчиков (антени) двух типов: катушка. вамотанная на ферритовом кольце (М2000НМ1) с внешним диаметром 1 см и с зазором в сердечнике 0.5 мас катушка без сердечника. Датчики первого типа использовались при исследовании издучений с малыми амплитудами. датчики второго тина — при исследовании излучений с большими выплитудами (при испытации дросселя 1.3). Измерения проводились с помощью осциллографа С1-102, имеющего частотную полосу до 10 МГи. Основная частота переключения силоных ключей инвертора составдяла 66 КГц. Верхняя частога спектров сигналов оценивалась по фронтим импульеных сигналов и составляла 3 МГц. На экране осциплографа воттролируются два сигнала: ток в испытуемом образце и сигнал от датчика (взиерителя помех). Идентичность форм и временных парамстров этих явух сигналов в случае испытания образца без экраиного покрытия свидетельствует о корректности измерении.

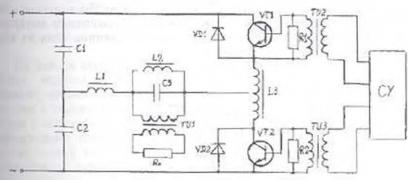


Рис. 2. Электрическая схема ИВЭП

Главная цель проведенных испытаний заключалась в оценке:
аффективности экранных покрытий из разных материалов (медь, никель,
алюминий и их композиции); эффективности экранирования при различных
толщинах экранного слоя, частотных свойств электромагнитных помех и
экранных покрытий.

Для цифровой обработки результатов измерений сигналы выскретизировались по премени с интервалом $\Delta t \ge 1/2F_{m,x}$, максимальная частога F_{max} в спектре сигнала оценивалась по минимальной длительности фронтов: $F_{max} = 1/I_{\phi min}$. Расчет спектров производился по алгоритму быстрого преобразования Фурье (БПФ). По БПФ определялись оценки вимплексного спектра сигнала x(t): $S_x(jf) = Re(f) + j \cdot Im(f)$. Далее вычислялись оценки энергетического спектра: $S_{xx}(f) = Re^x(f) + Im^x(f)$ и влудного спектра: $A(f) = S_{xx}(f)$, а также затухание на каждой частоте во формулам (1), (2).

Результаты экспериментальных исследований для дросселя 1.3 (рис. 1) с различными экранными покрытиями представлены на рис. 3, 4. Жиплитудный спектр сигнала для случая без экранного покрытия представлен на рис. 3 (кривая 3). Из спектра видно, что сигнал содержит составляющие со значительными амплитудами на частотах до 1.5 МГц.

Широкополосность сигнала позволяет судить об эффективности экранов в разных диапазонах частот. На рис. 3 (кривая 1) показана зависимость экранного затухания от частоты в случае покрытия из меди толщиной 50 мкм. В диапазоне до 0,6...0.7 МГц затухание заметно растет вместе с частотой. Эта тепденция еще более заметна в случае экранного покрытия на алюминия (рис.3, крипая 2, толщина покрытия - 90 мкм). На рис. 4 (кривая 3) представлена зависимость затухания от расстояния до источника издучения. Зависимости затухания от толщины слоя экранного покрытия (рис. 4, кривая 1 - для меди, кривая 2 - для алюминия) показывают, что в рассмотренном частотном диапазоне затухание растет вместе с толщиной покрытия, однако с некоторого значения (например, для меди толщиной 50 мкм) дальнейшее увеличение толщины имеет незначительное влияние.

Были исследованы также экранные покрытия из никеля. Исследования показали, что применение никеля в качестве экраниого покрытия для магнитных элементов ИВЭП неэффективно. Например, для выходных трансформаторов драйверов (TU2, TU3 на рис. 2) экранное покрытие из никеля толщиной в 50 мкм дает затухание в 4,86 дб, тогда как медный экран такой же толщины дает затухание 26 дб. Исследованись также экраны с чередованием слоев из магнитных и немагнитных материалов: никель и медь. Исследования показали, что добавление слоя из пикеля практически не влияет на затухание.

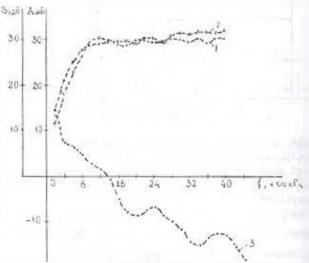


Рис. 3. Зависимости затухания S от частоты излучения (кривые 1 и 2) и частотный спектр излучения A (кривая 3)

Сравнение нараметров затухания от расстояния датчика до источника электромагнитного излучения с затуханием от применения экранных нокрытий (рис. 4) показывает, что удаление приемника от дросселя £3 на расстояние 1 = 25...30 мм эквивалентно применению экрана из меда толшиной 50 мкм. Следовательно, в случаях, когда плотность размещения элементов (т.е. габариты) ИВЭН не является определяющей, можно обеспечить ЭМС магнитных компонентов разумным удалением их друг от друга. В случаях плотного размещения компонентов единственным эффективным средством достижения ЭМС является применение экранкых нокрытий.

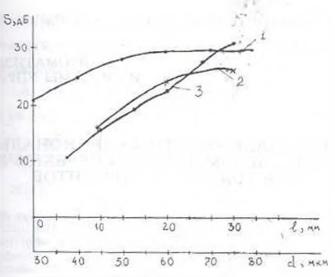


Рис. 4. Зависимости затухания S. кривые 1 и 2 - от толщины экрапа d: кривая 3 - от расстояния 1 от источника излучения до измерителя

На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы: экраны с большей удельной электропроводностью (меды, атоминий) намного эффективнее, чем экраны из магнитных материалов; затухание в экране растет в зависимости от толицины покрытия, однако, начиная с некоторого значения, дальнейшее увеличение толицины имеет незначительное влияние на затухание; для магнитных элементов ИВЭП с промежуточной частотой преобразования порядка 40...100 кГи можно декомендовать экранные покрытия из меди или алюминия с толициной примерно 50 мкм.

ЛИТЕРАТУРА

1 Кравченко В.И., Болотов Е.А., Летунов Н.И. Радиоэлектронные средства и мощные электроматинтные помехи. - М.: Радио и связь, 1987. - 256 с.

2. Laforé D. Déparasitage à la source des convertisseurs de puissance // Revue général délectricité. 1986. - Nº2. - P. 23-28

 Источники электропитания радиоэлектронной анпаратуры / Под ред. Г.С. Найвелта. - М. Радио и связь, 1986. - 576 с.

THYA 14.10.1996